EUROPEAN PATENT OFFICE



Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

02306440

PUBLICATION DATE

19-12-90

APPLICATION DATE

19-05-89

APPLICATION NUMBER

01126437

APPLICANT: NEC HOME ELECTRON LTD;

INVENTOR: TAKAHASHI JUNICHI;

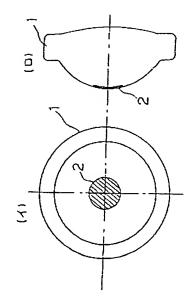
INT.CL.

G11B 7/135

TITLE

OBJECTIVE LENS FOR OPTICAL

HEAD AND THE HEAD



ABSTRACT: PURPOSE: To reduce the diameter of a converged beam by forming a circular mask at the center part of an aspherical mold lens to shield the center part of the lens within a certain radius range.

> CONSTITUTION: An objective lens 1 is equal to an aspherical mold lens like an aspherical plastic lens, an aspherical press glass lens, etc. A circular mask 2 is formed at the center part of the lens 1 with a coating of an opaque material, etc., to shield the center part of the lens 1 within a certain radius range. When a light beam is made incident on the lens 1, the aberration is corrected by a diffracting function of the mask 2. As a result, the diameter of a converged beam can be reduced without using a means which increases the NA of a lens.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio

⑩ 日本国特許庁(JP)

(1) 特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平2-306440

®Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

個公開 平成2年(1990)12月19日

G 11 B 7/135

A 8947-5D Z 8947-5D

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全5頁)

60発明の名称

光ヘツド用対物レンズおよび光ヘツド

②特 願 平1-126437

@出 願 平1(1989)5月19日

@発明者 髙

準 一

大阪府大阪市淀川区宮原3丁目5番24号 日本電気ホーム

エレクトロニクス株式会社

の出 願 人

日本電気ホームエレク

大阪府大阪市中央区城見1丁目4番24号

トロニクス株式会社

個代 理 人

弁理士 加川 征彦

明 福 書

1. 発明の名称

光ヘッド用対物レンズおよび光ヘッド 2. 特許請求の範囲

- (1) 非球面モールドレンズの中心部にこの中心部をある半径範囲で遅へいする円形のマスクを 設けたことを特徴とする光へッド用対物レンズ。
- (2)レーザ光源で発生させた光ビームを対物 レンズにより集取して光ディスク信号面に光スポットを形成し、光ディスク信号面で反射した反射 光を信号検出部で検出する光ヘッドにおいて、

前記対物レンズとして請求項1記載の対物レンズを用いるとともに、前記信号検出部の手前に、回折リングを遮へいするための円形スリットを設けたことを特徴とする光ヘッド。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

この発明は、光学手段を用いて記録媒体上に情報を記録し、あるいは既に記録されている情報を

再生する光ディスク装置 (光学式情報記録再生装置) に用いる光ヘッドおよびこの光ヘッドに用いる対物レンズに関する。

[従来の技術]

上記の光ディスク装置として再生専用の光ディスク装置、退配可能な追記型光ディスク装置、記録・再生・消去可能な書き換え型ディスク装置等がある。この種の光ディスク装置の光へッドに用いる健来の対物レンズとしては、球面ガラス組合・わせレンズ、非球面プラスチックレンズ、非球面ガラスアレスレンズ等その他がある。

[発明が解決しようとする課題]

ところで、特に追記型用、書き換え型用の光へッドでは、記録動作があることから、ディスク上に再生専用型の場合以上に小さなスポットを照射させる必要があり、そして、小さなスポットは第4回に示す収束ビーム径(ビームウエストの径)は。を小さくすることにより得られるから、収束ビーム径は。を十分小さくする必要がある。この収束ビーム径は。は、レーザ光の波長入、対物レ

DNIC ---- 4

特閉平 2-306440(2)

ンズの扇口数NA(NA=a/L)により定まり、 d。=K・み/NA

となる(ただし、Kは定数)。したがって、収束 ヒーム径 d。を小さくするためには、レーザ光の 波長入を小さくし、あるいは、NAの高いレンズ を用いなければならない。

一方、作動時の対物レンズとディスク面との距離つまり作動距離が短いと、対物レンズとディスクとの衝突が発生し易くなり、対物レンズあるいはディスクが損傷するので、光ヘッドの対物レンズに望まれる条件として、前記の作動距離が長いことが要求される。

しかし、レンズのNAを大きくしてスポット径を小さく較ることと、大きな作動距離として、ディスクとレンズとの衝突によるディスクまたはレンズの破損を防ぐこととは、相反する要求である。すなわち、レンズのNAを大きくすることは、レンズ半径aを一定とした場合魚点距離1を短くすることであり対物レンズの作動距離が短くなる。

なお、従来より、帯状の遮光板をレーザ光源か

-3-

前記対物レンズとして請求項1記載の対物レンズを用いるとともに、前記信号検出部の手前に、回折リングを選へいするための円形スリットを設けたことを特徴とする光ヘッドである。

〔作用〕 '

上記構成の対物レンズにおいては、円形マスクの存在による回折作用により収差補正が行われ、収束ビーム径が2次元的に、つまり直角2方向に小さくなる。この場合、小さくなった収束ビーム(メインローブ)の周囲にリング状の回折リング(サイドローブ)が生じる。

請求項 2 の光ヘッドにおいては、ディスクで反射し情報信号用の光検出器に入射する戻り光のなかの前記の無用な回折リングが円形スリットにより遮光され、メインローブのみが光検出器に入射する。

[実施例]

以下、本発明の一実施例を第1図~第3図を参照して説明する。

第1図(イ)、(ロ)は本発明一実施例の対物

ら対物レンズまでの光路中に配置して、対物レンズよる収束ビーム径を小さくする方法が、超解 像法として知られているが、この場合、帯状の遮 光板であるから、遮光板の編方向に関しては収束 ビームを絞ることができるが、遮光板の長さ方向 に関しては収束ビームを絞る作用はない。

本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、NAの低いレンズを使用することと、収束ピーム径を小さくすることとを同時に満たすことのできる対物レンズを得ることを主たる目的とする。

[課題を解決するための手段]

上記録題を解決する請求項1の発明は、非球面モールドレンズの中心部にこの中心部をある半径範囲で這へいする円形のマスクを設けたことを特徴とする光ヘッド用対物レンズである。

請求項2の発明は、レーザ光淑で発生させた光 ビームを対物レンズにより集束して光ディスク信 号面に光スポットを形成し、光ディスク信号面で 反射した反射光を信号検出部で検出する光ヘッド において、

-4-

レンズを示す。この対物レンズ1は、レンススができる。この対物レンズ、非球面でラスチックレルドレンスの非球面を生を範囲でされていいなるの中のまる。半径範囲のコーティグラススの中心を表現である。中では、カウスの中では、カウスの中では、カウスの中では、カウスの中では、カウスの中では、カウスの中では、カウスの中では、カウスの中では、カウスをからないのでは、カウスをからないがある。また、非球面では、カウスをの一般的な光学の一般のようには、カウスをからない。

この対物レンズ1に光ビームが入射した時、第 2図に実線で示す強度分布の収取ビームが得られる。つまり、本来の収取ビームである中心部の2次元的(直角 2 方向に) に較られたメインローブ (ディスク面に必要なスポットを形成する収束ビーム) Mと、その周囲にリング状に発生する弱い 回折リング (サイドローブ) が得られる。すなわ

-5~

特閉平 2-306440(3)

上記の対物レンズ 1 を用いた光ヘッドの一例を 第 3 図に示す。

図において、符号3は光ディスクであり、ディスク3面上に半導体レーザ4からのレーザ光を集 光する結像光学系は、コリメータレンズ5、整形

-7-

得られる。

ディスク3で反射した戻り光は、同じ経路で対物レンズ1、1/4波長板8を透過し、偏光ビームスプリッタ7で直角方向に反射され、ビームスプリッタ9、集光レンズ10を透過的前に、ビーススリット12を通過する。メインローブとととローブととなっト12で遮検サイイイイを対して、光田のみが透過し、無用なサイイドローブによるのように、明形なサイドローブによるのように、かので、サイドローブによるクロストークを防ぐことができる。

なお、円形マクク2により小さくできる収束ビーム役と、発生するサイドローブの強度とは互いに関係するので、円形マスクによるレンズの遮光率とレーザ光の波長入との組合わせを適切に選定して、収束ビーム径とサイドローブ強度を制御する。

[発明の効果]

アリズム 6、個光ビームスプリッタ7、1/4波及の対物レンズ1がディス1がディスカの対物レンズ3がディスの対象の大体でである。まび母子では、配置された様のの折りには、ないでは、1 ののでは、1 の

半導体レーザ4を出射したレーザ光は、コリメータレンズ5、整形アリズム6、 個光ビームスアリッタ7、1 / 4 波長板8を透過した後対物レンズ1で集光され、ディスク面にスポットを形成する。このスポットは前述した第2 図の強度分布であり、2 次元的に絞られた十分小さなスポットが

-8-

本発明は上記の通り構成されているので、次の ような効果を奏する。

非球面レンズの中心部に円形マスクを設けたので、この円形マスクにより収差補正が行われ、レンズのNAを大きくするする手段によらずに収束ビーム径を小さくすることができた。

収束ビーム径を小さくすることができるから、 高密度記録が可能となり、また、記録動作のある ため小さなスポットが必要な追記型および母き換 え型への適用が容易となる。

円形マスクにより収束ビーム径を小さくすることができるから、非球面モールドレンズの設計において(つまり収差補正のためのレンズ表面形状の設計において)、収差補正の補正量が少なく済み、収差補正のレンズ設計が容易になる。

低 N A レンズを用いることができるから (つまり 焦点距離の長いレンズを用いることができるから)、対物レンズとしての長い作動距離を得ることができ、ディスクとレンズとの衝突によるディスクまたはレンズの破損を防止することができる。

-9-



また、低NAレンズを用いることができるから、 安価になる。

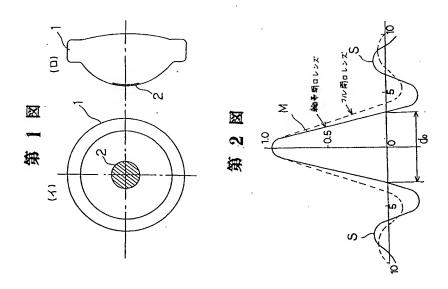
4. 図面の簡単な説明

第1図(イ)は本発明の一実施例を示す対物レンズの正面図、同図(ロ)は同断面図、第2図は同対物レンズにより収束された収束ビームの強度分布を示すグラフ、第3図は同対物レンズを使用した光ヘッドの光学系構成図、第4図は一般的な対物レンズを透過した光ビームの収束状態の説明

非球面モールドレンズ(対物レンズ)、
…円形マスク、12…円形スリット。

出額人 日本電気ホームエレクトロニクス株式会社 代理人 弁理士 加川征彦





THIS PAGE BLANK (USPT

